

Облікова картка ДіР



I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0219U100597

Державний реєстраційний номер: 0117U004875

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 20-02-2019

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 2

Назва етапу: Технологія формування наноструктурованих елементів для електроніки. Відпрацювання технологічних режимів формування нанорозмірних елементів для електроніки.

Початок етапу: 01.2018

Закінчення етапу: 12.2018

Вид звітнього документа: Остаточний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Науковий фізико-технологічний центр Міністерства освіти і науки та НАН України

Код за ЄДРПОУ: 14096245

Місцезнаходження: , м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61022, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: (0572) 321031

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Міністерство освіти і науки України

Код за ЄДРПОУ: 38621185

Місцезнаходження: просп. Перемоги, 10, м. Київ, Київ, 01135, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Кабінет Міністрів

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380444813221

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР: 34 - договір з МОН, іншими центральними органами виконавчої влади

Напрямок фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК): 2201040

Фактичний обсяг фінансування (тис. грн.): 789.5
--

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Технологія вакуумно-плазмового формування конструкційних елементів для наноелектроніки

Назва роботи англійською:

The technology of forming the vacuum-plasma structural components for nanoelectronics

Реферат українською:

Отримані зразки наноструктурованих елементів, зокрема на основі вуглецевих нанотрубок. Визначені фізико-технологічні характеристики отриманих нанорозмірних елементів. Визначені оптимальні технологічні параметри формування наноструктур. Розроблені рекомендації стосовно технології формування наноструктурованих елементів.

Реферат англійською:

Obtained samples of nanostructured elements, in particular on the basis of carbon nanotubes. The physical and technological characteristics of the nanosized elements obtained are determined. The optimum technological parameters of formation of nanostructures are determined. Recommendations on the technology of formation of nanostructured elements are developed.

Індекс УДК: 539.12.04, 621.384.653.539.12.04

Коди тематичних рубрик: 29.15.35

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Бажин Анатолій Іванович

Науковий ступінь: д. ф.-м. н.

Вчене звання: професор

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

Назва НТП українською: Технологія вакуумно-плазмового формування конструкційних елементів для наноелектроніки

Назва НТП англійською:

НТП, яку передбачалося створити:

Причини, через які НТП не було створено:

Отримані результати: Технології

Галузь застосування: Машинобудування

Реєстраційний номер картки технології:

Опис НТП: Розроблена технологія формування наноструктурованих елементів методом реактивного іонно-плазмового синтезу в багатофункціональній кластерній установці на основі модулів магнетронного, ВЧ індукційного та ВЧ ємнісного типів.

Соціально-економічна спрямованість НТП: Створення принципово нової продукції (матеріалів, технологій тощо) для забезпечення експортного потенціалу та заміщенню імпорту

Вплив НТП на довкілля:

Впровадження НТП: Впроваджено

Практична реалізація НТП

Початок етапу: 01.2019

Закінчення етапу: 12.2020

Споживачі продукції: Підприємства електроніки, машинобудування

Перспективні ринки: Україна, Європейський Союз

Характер співробітництва з інвестором

Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.: 2000

Права, що надаються інвестору після завершення роботи: Спільні права на НТП

Наявність бізнес-плану: Ні

Техніко-економічне обґрунтування: Так

Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.: 10000

Очікуваний термін окупності (років): 3

Додаткова інформація: Відсутня.

Назва НТП українською: Технологія формування наноструктур

Назва НТП англійською: The technology of vacuum-plasma formation of structural elements for nanoelectronics

НТП, яку передбачалося створити:

Причини, через які НТП не було створено:

Отримані результати: Технології

Галузь застосування:Машинобудування

Реєстраційний номер картки технології:

Опис НТП: Розроблена технологія формування наноструктурованих елементів методом реактивного іонно-плазмового синтезу в багатофункціональній кластерній установці на основі модулів магнетронного, ВЧ індукційного та ВЧ ємнісного типів.

Соціально-економічна спрямованість НТП: Створення принципово нової продукції (матеріалів, технологій тощо) для забезпечення експортного потенціалу та заміщенню імпорту

Вплив НТП на довкілля:

Впровадження НТП: Впроваджено

Практична реалізація НТП

Початок етапу: 01.2019

Закінчення етапу: 12.2020

Споживачі продукції: Підприємства електроніки, машинобудування

Перспективні ринки: Україна, Європейський Союз

Характер співробітництва з інвестором

Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.: 2000

Права, що надаються інвестору після завершення роботи: Спільні права на НТП

Наявність бізнес-плану: Ні

Техніко-економічне обґрунтування: Так

Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.: 10000

Очікуваний термін окупності (років): 3

Додаткова інформація: Відсутня.

IX. Бібліографічний опис

Звіт

X. Заключні відомості

Керівник юридичної особи

Фаренік Володимир Іванович
к. ф.-м. н.

Перелік осіб-виконавців

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Турбін П.В.

Телефон

+38 (093) 529-14-28

Реєстратор

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності**

